

Partial English Translation of
LAID OPEN unexamined
JAPANESE PATENT APPLICATION

Publication No. 2-280338

2. Claims

(1) A heterojunction bipolar transistor, characterized in that:

main semiconductor layers of a collector/contact layer made of InGaAs; a collector layer including a semiconductor layer made of InP; a base layer having an InGaAs end portion on at least the collector layer side; an emitter layer; and an emitter/contact layer are sequentially formed on an InP substrate.

(2) The heterojunction bipolar transistor of Claim 1, characterized in that:

the InP layer having a thickness W_c in the collector layer is composed of a layer containing an impurity of a first conductivity type of a concentration N_1 and a layer containing an impurity of a second conductivity type of a concentration N_2 and the relationship between the concentration N_1 and the concentration N_2 satisfies

$$\sqrt{\frac{2\epsilon}{q}} \times \sqrt{\frac{N_1 + N_2}{N_1 \times N_2}} \times \sqrt{E_g} > W_c$$

when ϵ is a dielectric constant of the InP substrate, q is an elementary charge and E_g is an energy bandgap of InGaAs.

(3) The heterojunction bipolar transistor of Claim 1 or 2,

characterized in that:

the base layer is made of InGaAs.

4. The heterojunction bipolar transistor of Claim 1 or 2, characterized in that;

the collector layer is composed of the InGaAs layer and the InP layer which are arranged in this order from the base layer side.

5. The heterojunction bipolar transistor of Claim 1 or 2, characterized in that;

the InP layers in the base layer and the collector layer are connected through a $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{As}_y\text{P}_{1-y}$ composition graded layer in which a composition changes from InGaAs to InP.

From line 12 of the upper left column to line 3 of the upper right column on page 5

Figure 4 shows a structure of the energy band of the main part of a heterojunction bipolar transistor according to another embodiment. In Figure 4, a composition graded collector layer 3g having a thickness of 50 nm and formed of $i\text{-Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{As}_y\text{P}_{1-y}$ ($X; 1 \rightarrow 0, Y; 0 \rightarrow 1$) is provided between the base layer 4 made of $p^+\text{-InGaAs}$ and the collector layer 3i made of the $i\text{-InP}$ in Figure 2. Discontinuity of the conductive band, which is generated between the base layer 4 and the collector layer 3i in Figure 2, is resolved. Accordingly, the electrons 13 can reach the collector layer 3i even if the electrons 13 lose much kinetic energy during traveling in the base layer 4.



(19)

(11) Publication number:

02280338 A

Generated Document

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 01100106

(51) Intl. Cl.: H01L 21/331 H01L 29/205 H01L 29/73

(22) Application date: 21.04.89

(30) Priority:

(43) Date of application
publication: 16.11.90(84) Designated
contracting states:

(71) Applicant: NEC CORP

(72) Inventor: TANAKA SHINICHI

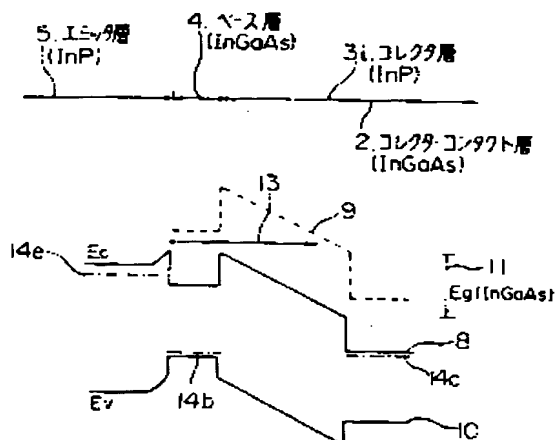
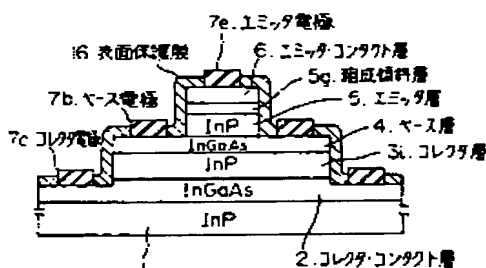
(74) Representative:

(54) HETEROJUNCTION
BIPOLAR TRANSISTOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve high frequency characteristic of an InGaAs heterojunction bipolar element by sequentially superposing an InGaAs collector contact layer, an InP collector layer, a collector layer side end with an InGaAs base layer and InP emitter layer, an emitter contact layer on an InP substrate.

CONSTITUTION: A main collector zone for determining a collector depleted layer running time of electrons is formed of an InP 3i having high energy position of a satellite lever 9. The collector end of a base layer 4 and a collector contact layer are made of InGaAs, a voltage drop 11 generated at the layer 3i is merely small E_g of the InGaAs except an external collector bias, and the average electric field intensity of the layer 3i is alleviated. Even with the same voltage drop the electric field intensity is deviated to so control distribution as not to exceed the height of the lever. As a result, a collector zone in which electrons can run at a high speed without transition to the lever is extended to improve high frequency characteristic.



COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑫ 公開特許公報(A) 平2-280338

⑬ Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成2年(1990)11月16日

H 01 L 21/331
29/205
29/73

8526-5F

8526-5F H 01 L 29/72

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全8頁)

⑮ 発明の名称 ヘテロ接合バイポーラトランジスタ

⑯ 特 願 平1-100106

⑰ 出 願 平1(1989)4月21日

⑱ 発 明 者 田 中 慎 一 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内
 ⑲ 出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号
 ⑳ 代 理 人 弁理士 岩佐 義幸

明 細 書

1. 発明の名称

ヘテロ接合バイポーラトランジスタ

2. 特許請求の範囲

(1) InP基板上に、InGaAsからなるコレクタ・コンタクト層、InPからなる半導体層を含むコレクタ層、少なくとも前記コレクタ層側の端がInGaAsであるベース層、エミッタ層、およびエミッタ・コンタクト層の主要な半導体層が順次形成されていることを特徴とするヘテロ接合バイポーラトランジスタ。

(2) 請求項1記載のヘテロ接合バイポーラトランジスタにおいて、

前記コレクタ層における厚み W_c を有するInP層が、濃度 N_1 の第1の導電型不純物を含む層および濃度 N_2 の第2の導電型不純物を含む層からなり、濃度 N_1 および濃度 N_2 は、次式

$$\sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \left(\frac{N_1 + N_2}{N_1 \cdot N_2} \right) E_g} > W_c$$

 ϵ : InP基板の誘電率 q : 電荷素量 E_g : InGaAsのエネルギー・バンドギャップ

を満たすことを特徴とするヘテロ接合バイポーラトランジスタ。

(3) 請求項1または請求項2記載のヘテロ接合バイポーラトランジスタにおいて、

ベース層がInGaAsからなることを特徴とするヘテロ接合バイポーラトランジスタ。

(4) 請求項1または請求項2記載のヘテロ接合バイポーラトランジスタにおいて、

コレクタ層が、ベース層側の端から順にInGaAs層とInP層とからなることを特徴とするヘテロ接合バイポーラトランジスタ。

(5) 請求項1または請求項2記載のヘテロ接合バイポーラトランジスタにおいて、

ベース層とコレクタ層におけるInP層とが、InGaAsからInPへ組成変化する $Ga_{1-x}In_xAs_yP_{1-y}$ 組成傾斜層によりつながっている

ることを特徴とするヘテロ接合バイポーラトランジスタ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はヘテロ接合バイポーラトランジスタに関するものである。

(従来の技術)

ヘテロ接合バイポーラトランジスタ (HBT) は大きな電流駆動能力と優れた高周波特性を併せもつ次世代の超高速デバイスとして注目されている。ヘテロ接合バイポーラトランジスタの高周波特性を決める遅延時間は、寄生容量の充電時間と、少数キャリアのベース走行時間と、コレクタ空乏層走行時間との総和からなるが、各々の要素は遅延時間全体の約 $1/3$ 程度の大きさになっている。

最近はその加工技術の進歩により寄生容量や寄生抵抗の低減が進んでいる他、ベース層をより薄膜化するとともに不純物濃度を非常に大きくする結晶成長技術の進歩により、ベース抵抗を増やすことなくベース走行時間の短縮が可能になってい

る。従ってコレクタ空乏層走行時間が素子内の遅延時間の中で相対的に大きくなっており、その低減がヘテロ接合バイポーラトランジスタを高性能化する上で主要な課題になっている。

現在、超高速デバイスとして主として研究されているヘテロ接合バイポーラトランジスタは $\text{AlGaAs}/\text{GaAs}$ 系であるが、 InP を基板とするヘテロ接合バイポーラトランジスタは、 InP に格子整合する半導体のエネルギー・バンドギャップが光ファイバ通信用の光波長領域 ($1.3 \sim 1.55 \mu\text{m}$) をカバーすることから発光・受光素子と格子定数上の互換性を持っており、光通信用 IC (OEIC) への応用が期待されている。 InP に格子整合する半導体の中で代表的な InGaAs は、 GaAs と比較して電子輸送特性に優れていること、電極との接触抵抗が小さいことなどから、高周波特性に優れたヘテロ接合バイポーラトランジスタ用の半導体材料としても有望である。しかし $\text{AlGaAs}/\text{GaAs}$ 系ヘテロ接合バイポーラトランジスタの高周波特性を大幅に凌ぐ素

子の実現のためには、 InGaAs 系ヘテロ接合バイポーラトランジスタに適したコレクタ構造が必要である。

第8図は $\text{AlGaAs}/\text{GaAs}$ ヘテロ接合バイポーラトランジスタを例にとった従来のエネルギー・バンド構造を示す図である。この従来例においては、半絶縁性 GaAs 基板の上に、 $n^+-\text{GaAs}$ (Si 不純物濃度: $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$) からなる厚み 500nm のコレクタ・コンタクト層 2、 $n^+-\text{GaAs}$ 層 (Si 不純物濃度: $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$) からなる厚み 500nm のコレクタ層 3、 $p^+-\text{GaAs}$ (Be 不純物濃度: $3 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$) からなる厚み 100nm のベース層 4、 $n-\text{Al}_{0.25}\text{Ga}_{0.75}\text{As}$ (Si 不純物濃度: $3 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$) からなる厚み 200nm のエミッタ層 5、 $n-\text{Al}_{0.1}\text{Ga}_{0.9}\text{As}$ (Si 不純物濃度: $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$) からなる厚み 50nm の組成傾斜層、 $n^+-\text{GaAs}$ (Si 不純物濃度: $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$) からなる厚み 100nm のエミッタ・コンタクト層が順次成長された構造になっている。

コレクタ層 3 に広がる約 200nm のコレクタ空乏層 3d には、外部コレクタ・バイアスを除いても GaAs のエネルギー・バンドギャップの大きさ約 1.4ボルトの電圧がかかるため、ベース層 4 を通過した電子 13 はコレクタ空乏層 3d に入ると即強電界の影響を受け、大きい有効質量を有する伝導帯のサテライト・バレー 9 へ遷移し、以後コレクタ空乏層 3d の大部分の区間をサテライト・バレー 9 の大きな有効質量で決まる遅い速度で走行する (図中 13' の位置)。なお第8図において、8 は伝導帯の底、10 は価電子帯の上限、14b、14c はフェルミ準位をそれぞれ示している。この従来例のヘテロ接合バイポーラトランジスタにおいては、上記のバレー間遷移に起因する長いコレクタ空乏層走行時間が素子の高周波特性を著しく制限している。

第9図は InP を基板とするヘテロ接合バイポーラトランジスタの従来例として、 $\text{InP}/\text{InGaAs}/\text{InP}$ ダブル・ヘテロ接合バイポーラトランジスタのエネルギー・バンド構造を示す図

である。コレクタ層3に用いられているInPはサテライト・バレー9が0.74eVと高いエネルギー位置に存在するため、InGaAsからなるコレクタ層を用いる場合より有利である。ところがコレクタ空乏層に生じる電圧降下11は、InGaAsのエネルギー・バンドギャップ E_g の大きさ0.75eVとInGaAs/InPの伝導帯エネルギー不連続の大きさ ΔE_c 約0.4eVとの和で決まる1.15ボルトと大きいため、第8図の場合と同様コレクタ空乏層走行時間が短くならない。なお第9図において、14eはフェルミ準位を示している。

第10図はコレクタ層3にInGaAsを用いたヘテロ接合バイポーラトランジスタの従来例を示す図である。この場合コレクタ空乏層にかかる電圧降下11は0.75ボルトと小さいが、サテライト・バレー9のエネルギー高さ0.55eVがInPの0.74eVと比較して低く、やはりサテライト・バレー9への遷移のためコレクタ空乏層走行時間が短くならない。

この問題を解決するためにAlGaAs/Ga

As系ヘテロ接合バイポーラトランジスタについて提案されているコレクタ構造を第11図を用いて説明する。このヘテロ接合バイポーラトランジスタはコレクタ構造のみ上記構造と異なっており、n⁺-GaAs (Si不純物濃度; $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$) からなる厚み500nmのコレクタ・コンタクト層2とi-GaAsからなる厚み200nmのコレクタ層3iとの間にp⁺-GaAs (Be不純物濃度; $2 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$) の厚み20nmの極薄膜p型シート層3pを挟んだコレクタ構造になっている。膜厚が十分薄いため完全空乏化しているp型シート層3pに生じる負に帯電したベリリウム不純物イオン15は、電子のポテンシャルを局所的に引き上げる役目をはたしている。その結果、全コレクタ層にかかる電圧は、その大部分がp型シート層3pとn⁺-GaAsコレクタ・コンタクト層2の間に

かかることになり、200nmのi-GaAsコレクタ層3iにかかる電界強度は大幅に緩和される。従ってコレクタ層に入った電子13は電界によってサテライト・バレー9へ遷移することなく、適度な電界強度に駆動されながら高速度でコレクタ層3iを通過する。なお第11図において、12はサテライト・バレーの高さを示している。

以上に述べたように電子のコレクタ空乏層走行時間を決める要因は主としてコレクタ空乏層内電界強度と、半導体固有のサテライト・バレーのエネルギー高さとの二つで与えられる。ヘテロ接合バイポーラトランジスタの高周波特性を改善するためには前者はあまり強過ぎず適度な強度を持つことが必要で、後者は大きいほど良い。

〔発明が解決しようとする課題〕

上記のようなi-コレクタ層とn⁺-コレクタ・コンタクト層との間に極薄膜p⁺層を挿入するi-p⁺-n⁺構造は、両側において不純物が高濃度にドーピングされたpn接合をもつためコレクタ耐圧が低下することが懸念される。AlGaAs/GaAs系ヘテロ接合バイポーラトランジスタのように比較的エネルギー・バンドギャップの大きい半導体材料を用いる場合はそれほど深刻な問題はないが、例えば第10図のようにコレクタ層にエ

ネルギー・バンドギャップの小さなInGaAsを用いたヘテロ接合バイポーラトランジスタにおいては、前記のようなコレクタ構造の適用は困難である。

一方、第9図のようにコレクタ層にエネルギー・バンドギャップの比較的大きなInPを用いた場合は製造上の問題がある。すなわちInPは極薄膜結晶成長の制御性に優れたMBE法では結晶成長できず、またInPの成長に一般によく用いられる有機金属気相成長法(MOCVD法)では不純物を20nm程度という極薄膜の中に閉じ込めることはできず、従ってInPを用いたi-p⁺-n⁺構造は技術的な困難を伴う。

本発明の目的は、上記課題を解決し、InPを基板とするInGaAs系ヘテロ接合バイポーラトランジスタのコレクタ層走行時間を短縮するコレクタ層構造を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

本発明のヘテロ接合バイポーラトランジスタはInP基板上に、InGaAsからなるコレクタ

・コンタクト層、InPからなる半導体層を含むコレクタ層、少なくとも前記コレクタ層側の端がInGaAsであるベース層、エミッタ層、およびエミッタ・コンタクト層の主要な半導体層が順次形成されていることを特徴とする。

本発明によれば、前記コレクタ層における厚み W_c を有するInP層が、濃度 N_1 の第1の導電型不純物を含む層および濃度 N_2 の第2の導電型不純物を含む層からなり、濃度 N_1 および濃度 N_2 は、次式

$$\sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \left(\frac{N_1 + N_2}{N_1 \cdot N_2} \right) E_g} > W_c$$

ϵ : InP基板の誘電率

q : 電荷素量

E_g : InGaAsのエネルギー・バンドギャップ

を満たすのが望ましい。

また、ベース層はInGaAsで構成することができる。

また、コレクタ層は、ベース層側の端から順に

することができる。

これらの結果、電子がサテライト・バレーへ遷移しないで高速走行できるコレクタ区間は、従来のInGaAs系ヘテロ接合バイポーラトランジスタの場合より大幅に延長され、素子の高周波特性が改善される。

(実施例)

以下本発明のヘテロ接合バイポーラトランジスタの実施例を説明する。

第1図において、半絶縁性InP基板1上に有機金属気相成長法(MOCVD法)によりInPに格子整合した n^+ -InGaAs(Si不純物濃度: $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$)からなる厚み500nmのコレクタ・コンタクト層3i、 p^+ -InGaAs(Be不純物濃度: $3 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$)からなる厚み200nmのエミッタ層5、 n -Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}(X: 0→1, Y: 1→0, Si不純物濃度: $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$)からなる層50nmの組成傾斜層5g: n^+ -InGaAs(Si不純物濃度: $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$)からなる厚み100nmのエミッタ・コ

InGaAs層とInP層とで構成することができる。

また、ベース層とコレクタ層におけるInP層とを、InGaAsからInPへ組成変化するGa_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}組成傾斜層によりつなぐようにしても良い。

(作用)

本発明のヘテロ接合バイポーラトランジスタにおいては、電子のコレクタ空乏層走行時間が決まる主要なコレクタ区間は、サテライト・バレーのエネルギー位置の高いInPからなっている。またベース層のコレクタ端とコレクタ・コンタクト層がInGaAsであるため、コレクタ層に生じる電圧降下は外部コレクタ・バイアスを除くとInGaAsの小さなエネルギー・バンドギャップの大きさに過ぎず、従ってコレクタ層における平均電界強度が緩和される。また同じコレクタ層の電圧降下でも電界強度を偏在させることにより、電子エネルギーがサテライト・バレーの高さよりも大きくならないよう電子エネルギー分布を制御

ンタクト層6が順次成長された構造になっている。

なお第1図において、7cはコレクタ電極、7bはベース電極、7eはエミッタ電極、16は表面保護膜である。

第2図は第1図のヘテロ接合バイポーラトランジスタの主要部のエネルギー・バンド構造を示す図である。図においてベース層4とコレクタ・コンタクト層2とはInGaAsからなるためコレクタ層3iにおける電圧降下11は外部バイアスを除いて高々InGaAsの小さなエネルギー・ギャップ E_g の大きさ0.75eVにすぎない。従ってコレクタ層3iにおける電界強度が抑えられ、さらにコレクタ層3iをなすInPのサテライト・バレー9のエネルギー位置が高いことから電子13がバレー遷移をしないで高速走行できるコレクタ区間は従来のInGaAs系ヘテロ接合バイポーラトランジスタの場合より大幅に延長される。

なお第2図において、8は伝導帯の底、10は価電子帯の上限、14b, 14cはフェルミ準位を示している。

第3図は他の実施例であるヘテロ接合バイポーラトランジスタの主要部のエネルギー・バンド構造を示す。第3図においては、第2図における $p^+-InGaAs$ からなるベース層4と $i-InP$ からなるコレクタ層3iの間に $n-InGaAs$ (Si不純物濃度; $5 \times 10^{17} cm^{-3}$) からなる厚み50nmの第2のコレクタ層3nを設けている。これにより電子13がベース層4を走行中に光学フォノン散乱などによりある程度の運動エネルギーを失っても、コレクタ層3iへ電子が到達できる割合を増やすことができる。

第4図はさらに他の実施例であるヘテロ接合バイポーラトランジスタの主要部のエネルギー・バンド構造を示す。第4図においては、第2図における $p^+-InGaAs$ からなるベース層4と $i-InP$ からなるコレクタ層3iとの間に $i-GaxIn_{1-x}As_yP_{1-y}$ ($X: 1 \rightarrow 0, Y: 0 \rightarrow 1$) からなる厚み50nmの組成傾斜コレクタ層3gを設けており、第2図におけるベース層4とコレクタ層3iとの間に生じる伝導帯の不連続を消去

している。これにより電子13がベース層4を走行中に失う運動エネルギーが大きくても、電子はコレクタ層3iへ到達することができる。

次に、コレクタ層の InP を低濃度の不純物でドーブしたヘテロ接合バイポーラトランジスタの実施例について説明する。

第5図は、一例であるヘテロ接合バイポーラトランジスタのエネルギー・バンド構造を示す。第5図においては、厚み200nmの InP コレクタ層の内、ベース側100nmの区間3πはp型不純物であるベリリウムが、コレクタ・コンタクト側100nmの区間3νはn型不純物であるシリコンが各々 $3 \times 10^{16} cm^{-3}$ ドーブされている。

また第6図は、他の例であるヘテロ接合バイポーラトランジスタのエネルギー・バンド構造を示す。第6図においては、逆にベース側100nmの区間3νはn型不純物であるシリコンが、コレクタ・コンタクト側100nmの区間3πはp型不純物であるベリリウムが各々 $3 \times 10^{16} cm^{-3}$ ドーブされている。

第5図、第6図いずれの場合でも、これらの不純物濃度が低い場合ベース・コレクタ間にバイアスがかかっていない状態でも InP 層は空乏化しており、イオン化不純物の空間電荷により電界分布の偏りが生じる。なお図中、8i, 10i は不純物物がドーブされていない場合のエネルギー・バンド構造を表す。

第2図、第5図および第6図において示したヘテロ接合バイポーラトランジスタのコレクタ層内の電界分布の様子を第7図に示す。第7図において16, 17, 18は、各々第2図、第5図、第6図の InP コレクタ層内の電界分布を表しており、Wcはコレクタ層の厚みを示している。

第2図のヘテロ接合バイポーラトランジスタの場合、不純物がドーブされていないコレクタ層内の電界分布16は全区間を通じて一定である。

第5図のヘテロ接合バイポーラトランジスタの場合、コレクタ層内の電界分布は中央に偏在しており、端では電界は弱くなっている。この場合コレクタ層前半から中央にかかる電界加速によりホ

ットエレクトロン化した電子はサテライト・バレーへ遷移しやすい状態になっているため、コレクタ層後半の電界を抑えてサテライト・バレーへの遷移を防いでいる。

第6図のヘテロ接合バイポーラトランジスタの場合、コレクタ層内の電界分布はコレクタ層の端に偏在しており、逆に中央では電界はほとんどなくなっている。この場合コレクタ層のベース端に偏在している電界で電子をある程度加速し初期エネルギーを与えておいて、コレクタ層の中央では電界を抑えることにより電子の高速走行を維持させている。最後は電界強度が再度強くなるが、コレクタ層のほとんどの区間を高速走行するためコレクタ層走行時間全体に与える影響は小さい。

以上の各実施例においては、ベース構造として均一なエネルギー・バンドギャップをもつ $InGaAs$ を用いたが、例えば $InAl_{1-x}Ga_{1-x}As$ を用いた傾斜エネルギー・バンドギャップ構造をもつものでよい。結晶は格子整合系に限らず、ベース層をなす $InGaAs$ の組成を格子整合系

件からずらした歪ベースを有するヘテロ接合バイポーラトランジスタにも本発明は適用できる。

(発明の効果)

本発明により InP を基板とした InGaAs 系ヘテロ接合バイポーラトランジスタのコレクタ空乏層走行時間を大幅に短縮することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のヘテロ接合バイポーラトランジスタの一実施例を示す構造断面図、

第2図は第1図のヘテロ接合バイポーラトランジスタ主要部のエネルギー・バンド構造を示す図、

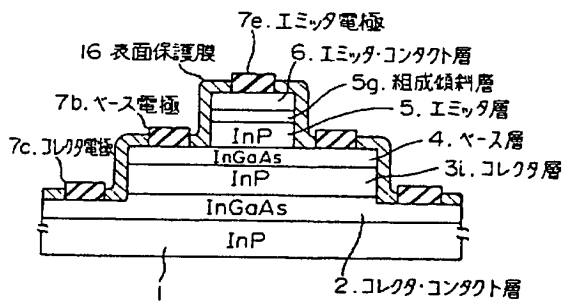
第3図～第6図はそれぞれ他の実施例であるヘテロ接合バイポーラトランジスタ主要部のエネルギー・バンド構造を示す図、

第7図は本発明のヘテロ接合バイポーラトランジスタにおけるコレクタ空乏層内の電界分布を示す図、

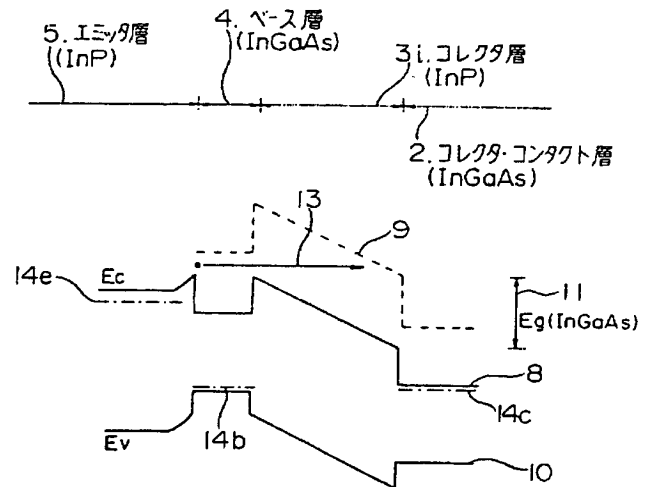
第8図～第11図は従来のヘテロ接合バイポーラトランジスタ主要部のエネルギー・バンド構造を示す図である。

- 1 半絶縁性基板
- 2 コレクタ・コンタクト層
- 3, 3i コレクタ層
- 4 ベース層
- 5 エミッタ層
- 6 エミッタ・コンタクト層
- 7e, 7b, 7c 電極
- 8 伝導帯の底
- 9 伝導帯のサテライト・バレー
- 10 価電子帯の上限
- 12 サテライト・バレーの高さ
- 13 バレー遷移しないで走行する電子
- 13' バレー遷移した後走行する電子
- 14a, 14b, 14c フェルミ準位
- 15 イオン化したベリリウム不純物
- 16 表面保護膜

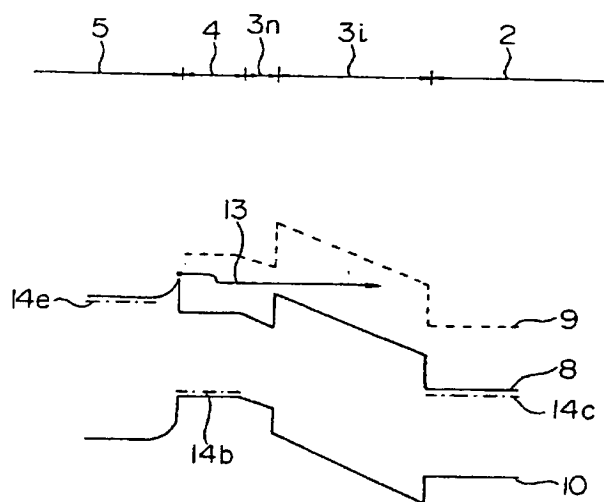
代理人 弁理士 岩 佐 義 幸



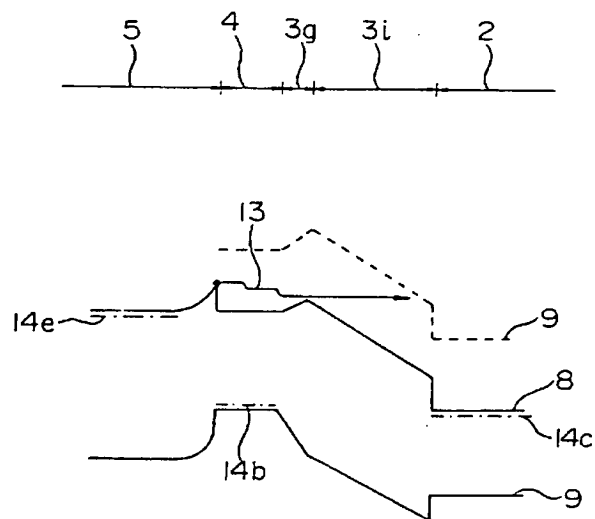
第 1 図



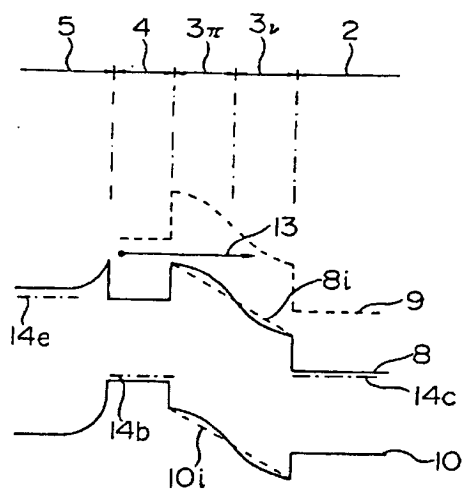
第 2 図



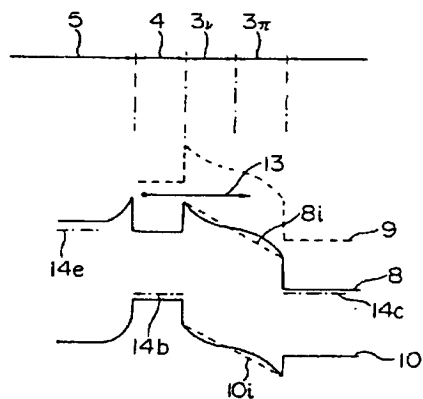
第 3 図



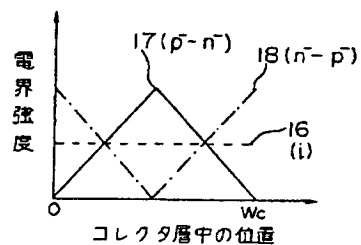
第 4 図



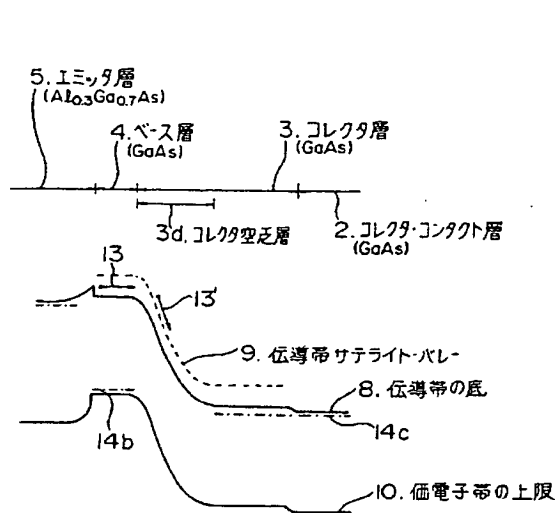
第 5 図



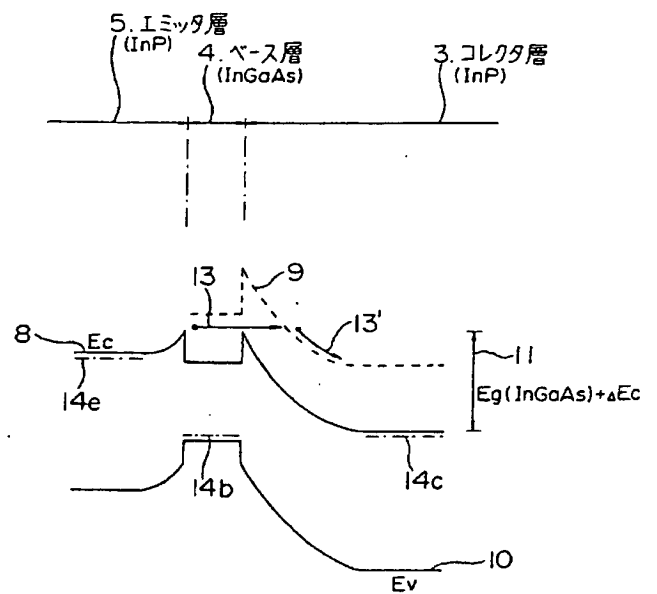
第 6 図



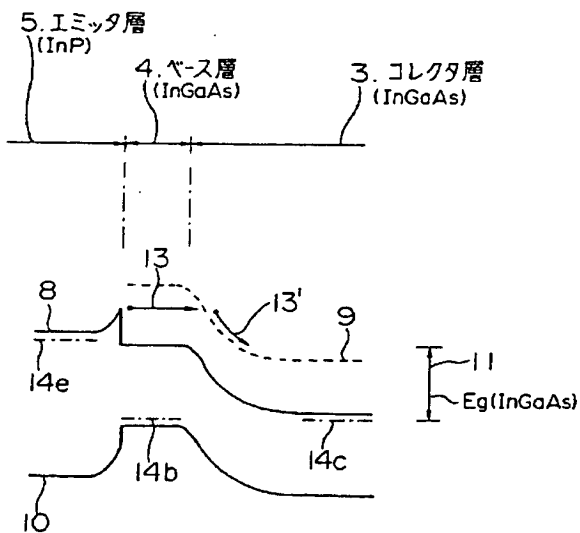
第 7 図



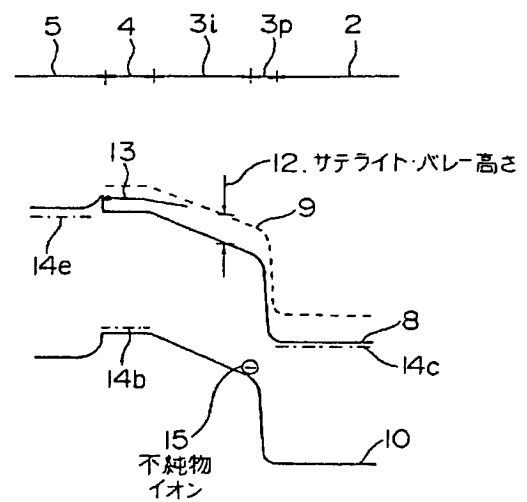
第 8 図



第 9 図



第 10 図



第 11 図